

고속 측각 분광복사계 및 그 측정방법

특허등록번호

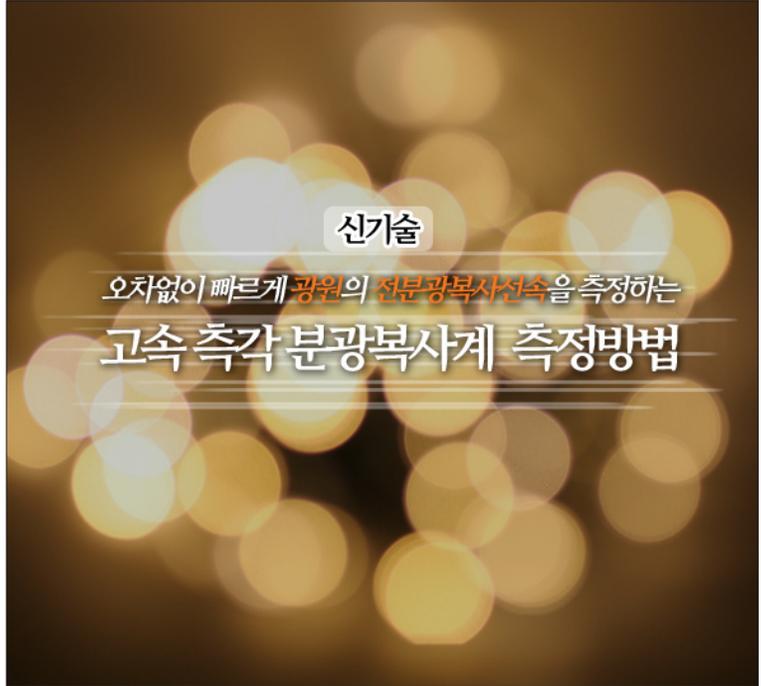
10-1486285

특허명

고속 측각 분광복사계 및 그 측정방법

대표발명자

광도센터 박성중



배광과 형광의 단점을 극복한 조명기기 성능평가용 측각분광복사계 제작 기술



빛을 내는 광원의 전분광복사선속 측정은 조명효율, 전광선속 등 광원의 모든 특성을 산출하기 때문에 조명기기 성능평가에 아주 중요합니다. 하지만 일반적인 전분광복사선속 측정 방법은 형광과 배광에 의해 불확도 요인이 발생한다는 단점이 있는데요.

소개해드릴 KRISS의 기술은 이런 배광과 형광의 단점을 극복한 측각분광복사계 제작 기술입니다. 이는 자외선, 적외선 등 다양한 광원에서 오차 없이 고속으로 광원의 전분광복사선속 측정이 가능하며 비용도 크게 절약할 수 있습니다.

눈에 보이지 않는 자외선 · 적외선을 이용한 LED 분야에서의 수요가 기대되는 KRISS의 기술을 만나보세요!